

第二專長名稱	光機電工程			
負責單位	機械工程系			
類別	課程名稱	課號	學分數	備註
基礎課程	靜力與材料力學	ME1006	4	至少修習11學分
	製造工程實習 I	ME1041	1	
	製造工程實習 II	ME1042	1	
	機械製圖	ME2037	1	
	基礎工程光學 I	ME2003	3	
	基礎工程光學 II *	ME2004	3	
	動力學 (先修:靜力與材料力學)	ME2013	3	
	機構學	ME2035	3	
	電路及電子學*	ME2065	3	
	工程程式設計	EG1001	3	
進階課程	電腦輔助製圖 (先修:機械製圖)	ME3001	3	至少修習6學分
	電磁及電動機* (先修:電路與電子學)	ME3054	3	
	感測原理* (先修:電路與電子學)	ME3056	3	
	系統動態* (先修:動力學)	ME3060	3	
	自動控制 I * (先修:工程程式設計)	ME4061	3	
	機電整合* (先修:電路及電子學)	ME4076	3	
	機器人學* (先修:靜力與材料力學、機械製圖、機構學、工程程式設計)	ME6061	3	
	自動化光學檢測 (先修:機械製圖、工程程式設計、基礎工程光學 I、基礎工程光學 II)	OM5003	3	
	光學機構系統設計與分析	OM5006	3	
	光學量測 (先修:基礎工程光學 I、基礎工程光學 II)	OM6013	3	
工程光學設計與應用 (先修:基礎工程光學 I)	OM6026	3		
補充說明：				
1. 全部課程至少修習20學分，其中包含基礎課程至少11學分，進階課程至少6學分。				
2. 須具備微積分及普通物理 A 之基礎。				
3. 有註明*號的課程須具備工程數學I之基礎。				
4. 有區分 I 與 II 之課程需先修畢 I 後始得修習 II。				